## BEST AVAILABLE COPY

### (12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

## (19) Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Bureau international





(43) Date de la publication internationale 12 février 2004 (12.02.2004)

## PCT

# (10) Numéro de publication internationale WO 2004/013059 A2

(51) Classification internationale des brevets<sup>7</sup>:

C03C

(74) Mandataire: SAINT-GOBAIN RECHERCHE; 39, quai Lucien Lefranc, F-93300 Aubervilliers (FR).

(21) Numéro de la demande internationale :

PCT/FR2003/002451

- (22) Date de dépôt international: 1 août 2003 (01.08.2003)
- (25) Langue de dépôt :

français

(26) Langue de publication :

français

(30) Données relatives à la priorité :

102 35 154.6

1 août 2002 (01.08.2002) I

- (71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US): SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE [FR/FR]; 18, avenue d'Alsace, F-92400 Courbevoie (FR).
- (72) Inventeurs; et
- (75) Inventeurs/Déposants (pour US seulement): SCHICHT, Heinz [DE/DE]; Dorfstrasse 72, 06925 Bethau (DE). IHLO, Lars [DE/DE]; An Den Linden 50, 04889 Pflückuff (DE). SCHMIDT, Uwe [DE/DE]; Oststrasse 7, 04895 Falkenberg (DE). SCHINDLER, Herbert [—/DE]; 04860 Torgau (DE).

(81) États désignés (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM,

HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD,

SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,

(84) États désignés (régional): brevet ARIPO (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), brevet eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), brevet européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), brevet OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

#### Publiée:

 sans rapport de recherche internationale, sera republiée dès réception de ce rapport

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.

- (54) Title: PRESTRESSABLE LAYER SYSTEM FOR PARTITION GLASS
- (54) Titre: SYSTEME DE COUCHES APTE A ETRE PRECONTRAINT, POUR VITRAGES
- (57) Abstract: The inventive prestressable and flexural layer system with a low emissivity is used for a partition glass and is provided with a functional silver layer and a metallic sacrificed layer which is made of Ti or a Ti alloy and of Zn and/or Al and arranged thereunder. Said system also comprises anti-reflection dielectric layers and an oxidised covering layer which is nitrided or oxynitrided. The metallic sacrificed layer contains chemically bound hydrogen. A ZnO layer eventually stimulated with Al and/or In is adjacent to the metallic sacrified layer. The covering layer comprises a titanium compound. The analogous layer systems can be produced in a comparatively economical manner exhibiting a high hardness and chemical resistance. The colour parameters of said systems are easily reproducible even when they are thermally treated at a high temperature.
  - (57) Abrégé: Un système de couches à faible émissivité, apte à être cintré et précontraint, pour vitrages, avec de l'argent comme couche fonctionnelle, comprend une couche métallique sacrifiée, en Ti ou en un alliage de Ti et de Zn et/ou d'A1, disposée au-dessus de la couche d'argent, des couches diélectriques antiréfléchissantes et une couche de recouvrement oxydée, nitrurée ou oxynitrurée. La couche métallique sacrifiée contient de l'hydrogène lié chimiquement. Une couche de ZnO, éventuellement dopée à l'A1 et/ou à l'In, est adjacente à la couche métallique sacrifiée. La couche de recouvrement est constituée d'un composé de titane. Des systèmes de couches de ce type peuvent être fabriqués de manière relativement économique et présentent une dureté élevée et une haute résistance chimique. Leurs paramètres de teinte sont bien reproductibles, même en cas de traitement thermique à haute température.



WO 2004/013059 A2

Système de couches apte à être précontraint, pour vitrages

L'invention concerne un système de couches à faible émissivité, apte à être fortement sollicité thermiquement, pour vitrages, avec de l'argent comme couche fonctionnelle, une couche métallique sacrifiée disposée au-dessus de la couche d'argent, des couches diélectriques antiréfléchissantes et une couche de recouvrement oxydée, nitrurée ou oxynitrurée.

Les systèmes de couches à faible émissivité doivent pouvoir être fortement sollicités thermiquement lorsque les vitrages revêtus subissent une opération de flexion 15 et/ou de précontrainte. Bien que des couches thermiquement stables ne soient pas nécessaires lorsque les vitrages ne sont revêtus qu'après la flexion et la précontrainte, cela présente le désavantage qu'il n'est pas toujours possible d'éviter des défauts revêtement. Ces défauts résultent de ce que l'opération 20 de traitement thermique entraîne souvent à la surface du verre des modifications locales qui deviennent visibles après 1e revêtement. En particulier, revêtement qui précède l'opération de traitement thermique présente par ailleurs l'avantage économique 25 de simplifier l'opération de revêtement parce que l'on revêtir de grands vitrages sur grandes installations industrielles. Les formats souhaités sont ensuite découpés dans les grands vitrages revêtus et courbés et/ou précontraints de la manière accoutumée. 30

Des systèmes đe couches aptes à être fortement sollicités thermiquement sont connus en différents réalisation. Dans modes de un premier groupe systèmes de couches aptes à être fortement sollicités thermiquement, les couches antiréfléchissantes chacune constituées de Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> et sont séparées de la couche fonctionnelle en argent par de minces couches métalliques sacrifiées de CrNi. Des systèmes de couches

## copie de confirmation

35

5

2

qui présentent cette structure sont par exemple décrits dans les documents EP 0 567 735 B1, EP 0 717 014 B1, EP 0 771 766 B1, EP 0 646 551 B1 et EP 0 796 825 A2. Le système de couches décrit dans EP 0 883 585 B1 appartient également à ce groupe mais dans ce cas, la couche métallique sacrifiée est constituée de Si. Bien que de tels systèmes de couches soient thermiquement très stables, ils sont très coûteux à fabriquer à cause problèmes connus qui se posent lors pulvérisation de nitrures. En outre, la pulvérisation de couches  $Si_3N_4$ relativement épaisses problématique à cause des contraintes mécaniques dans les couches.

Au deuxième groupe de systèmes de couches aptes à être 15 fortement sollicités thermiquement appartiennent ceux qui, en plus de couches nitrurées telles que Si3N4 ou présentent également des couches oxydées, particulier dans la zone de la couche de recouvrement. DE 196 40 800 C2 décrit 20 par exemple un système couches dans lequel une couche intermédiaire en nitrure oxynitrure du métal de la couche métallique sacrifiée est disposée entre la couche métallique de blocage et la couche de recouvrement oxydée nitrurée. Un autre système de couches de ce type, connu 25 à partir de DE 101 05 199 C1, se caractérise en qu'une couche en Si3N4 ou AlN est disposée entre couche d'argent et la couche métallique sacrifiée. Dans système de couches connu à partir de 0 834 483 B1, une couche intermédiaire en TiO2 d'une 30 épaisseur d'au moins 5 nm est disposée entre une couche métallique sacrifiée en Tiet la couche recouvrement, et une couche de recouvrement en oxyde, nitrure ou oxynitrure de Bi, Sn, Zn ou d'un mélange de ces métaux est disposée sur cette couche intermédiaire. 35 Tant les couches intermédiaires en  $Si_3N_4$  ou AlN que des

couches épaisses en  $ext{TiO}_2$  sont compliquées à fabriquer.

épaisses

à haut indice de

En

outre,

des

couches

٠.-

5

3

réfraction en TiO<sub>2</sub> imposent des exigences élevées à la régularité de l'épaisseur de la couche, et déjà de faibles écarts d'épaisseur de la couche peuvent entraîner des erreurs de teinte après l'opération de précontrainte.

Dans un troisième groupe de systèmes de couches aptes à être fortement sollicités thermiquement, les couches individuelles sont constituées de couches purement oxydées, à l'exception de la couche fonctionnelle et de couche métallique sacrifiée. Comme des couches oxydées peuvent la plupart du temps être pulvérisées problème, de tels systèmes de couches économiques à fabriquer. Cependant, dans ce cas, couche métallique sacrifiée présente une épaisseur relativement grande. Un système de couches de ce type est par exemple décrit dans DE 198 52 358 C1. Le métal sacrifié dans ce est cas constitué d'un d'aluminium avec un ou plusieurs des éléments Mg, Mn, Cu, Zn et Si comme composants d'alliage.

Dans EP 0 233 003 B1, on décrit également un système de couches purement oxydé pour vitrages, qui doit convenir à une opération de flexion et/ou de précontrainte. Dans ce système de couches connu, une couche en Al, Ti, Zn ou Ta d'une épaisseur de 4 à 15 nm est disposée audessus de la couche d'argent. De préférence, une couche en Al, Ti, Zn ou Ta est également disposée en dessous de la couche d'argent.

30

35

10

15

20

Dans DE 39 41 027 C2 est décrit un système de couches oxydées qui doit convenir pour la flexion et/ou la précontrainte. Dans ce système de couches connu, en dessous de la couche d'argent est disposée une couche de ZnO d'une épaisseur d'au plus 15 nm, et le recouvrement de la couche d'argent est un oxyde d'un métal sacrifié du groupe du titane, de l'aluminium, de l'acier inoxydable, du bismuth, du zinc ou de mélanges

4

de ces oxydes, qui est formé par dépôt du métal sacrifié et sa conversion en oxyde.

La teinte de réflexion de tous les systèmes de couches connus se modifie de manière plus ou moins nettement visible après le traitement thermique nécessaire pour la flexion et/ou la précontrainte des vitrages. règle générale, ils présentent en outre une émissivité accrue après le traitement thermique et une proportion accrue de diffusion de la lumière. A cause de la modification de la teinte de réflexion, on reconnaît à l'oeil nu des vitrages revêtus et traités thermiquement qui sont incorporés dans une même façade à côté de vitrages non traités thermiquement mais présentant le même système de couches. Dans ce but, il faut par conséquent un autre système de couches apte à être précontraint, dont les propriétés soient comparables à celles d'un système de couches non traité thermiquement.

20

25

15

10

Le respect simultané des trois conditions importantes, à savoir le maintien d'une teinte de réflexion étroitement définie ainsi que si possible aucune augmentation ou uniquement une faible augmentation de la proportion de lumière diffusée et de l'émissivité par l'opération de traitement thermique est d'autant plus difficile à atteindre que les exigences en termes de neutralité de teinte du système de couches sont plus élevées.

30

35

Le problème à la base de l'invention consiste donc à mettre au point un système de couches de teinte neutre avec des couches antiréfléchissantes essentiellement oxydées qui, après une opération de traitement thermique par exemple nécessaire pour la courbure et/ou la précontrainte du vitrage, présentent en réflexion essentiellement les mêmes paramètres de teinte qu'un système de couches oxydé prédéterminé et non traité

5

thermiquement, et dans lequel le traitement thermique augmente aussi peu que possible la proportion de lumière diffusée et l'émissivité. En même temps, le système de couches devra présenter une dureté élevée et une haute résistance chimique.

Selon l'invention, ce problème est résolu en ce que la couche métallique sacrifiée est constituée de Ti ou d'un alliage de Ti et de Zn et/ou Al, et contient de l'hydrogène lié chimiquement, en ce qu'une couche en ZnO éventuellement dopée à l'Al et/ou à l'In se raccorde à la couche métallique sacrifiée et en ce que la couche de recouvrement est constituée d'un composé du titane.

15

10

5

Des systèmes de couches présentant la structure selon l'invention peuvent être fabriqués de manière relativement économique et présentent une dureté élevée et une haute résistance chimique. Mais en particulier, ils se caractérisent par le fait qu'avec une opération 20 de traitement thermique même à haute température, leur aspect coloré peut être modifié de façon contrôlée et bien reproductible et qu'ils ne présentent qu'une très faible augmentation de la proportion de lumière 25 diffusée et une faible émissivité.

A l'évidence, la composition de la couche de métal sacrifié qui est pulvérisée dans une atmosphère de gaz de travail d'Ar/H<sub>2</sub>, joue un rôle particulier. Comme le Ti métallique a la propriété de se lier à l'hydrogène, l'effet de protection de la couche métallique sacrifiée vis-à-vis de la couche d'argent est encore renforcé par un "tampon d'hydrogène" réducteur. L'hydrogène de la couche métallique sacrifiée peut être détecté à l'aide de méthodes analytiques appropriées.

Des alliages de titane contenant de 50 à 80 % en poids de Ti et de 20 à 50 % en poids d'Al se sont par exemple

30

6

avérés convenir particulièrement bien pour la couche métallique sacrifiée.

L'agencement de la couche de ZnO éventuellement dopée à l'Al ou à l'In directement sur la couche métallique 5 sacrifiée contribue considérablement au souhaité. Cette couche de ZnO peut présenter une épaisseur telle qu'elle constitue déjà elle-même la couche antiréfléchissante, de sorte que la couche de recouvrement suit immédiatement cette couche de ZnO. 10 Cependant, il est également possible de ne prévoir qu'une couche de ZnO relativement mince qui agit alors comme couche partielle de la couche antiréfléchisante, tandis que la couche partielle de la antiréfléchissante qui s'y raccorde est par exemple 15 constituée de SnO2. Mais dans ce cas, il est nécessaire que l'épaisseur de la couche de ZnO atteigne au moins 3 nm.

La couche de recouvrement du système de couches est de 20 préférence un oxyde mixte à structure en spinelles, mais des alliages binaires du type Ti/Al conviennent également. Les composés suivants conviennent particulièrement bien pour la couche de recouvrement: 25 ZnO:Al/TiO2, ZnO:Al/Ti,  $Zn_xSn_yO_z/TiO_2$ ,  $Zn_xSn_yO_z/Ti$ , Zn<sub>x</sub>Ti<sub>v</sub>Al<sub>z</sub>O<sub>r</sub>,  $Ti_xAl_vO_z$ ,  $Ti_{x}Al_{y}$ , TixAlyNz, TixAlvOzNr,  $\label{eq:snySbzOrTiO2} Zn_xSn_ySb_zO_r/\text{Ti} \ \text{ou} \ Zn_xSn_yAl_zO_r/\text{TiO}_2. \ \text{Comme}$ il s'agit ici d'alliages de titane, ils représentent l'état de la couche de recouvrement avant l'opération de traitement thermique au cours de laquelle ils sont 30 ensuite convertis en la forme oxydée.

Des compositions préférées de la couche métallique sacrifiée et des autres couches du système de couches ainsi que les plages préférées d'épaisseur des couches individuelles ressortent des revendications dépendantes.

₹.

7

L'invention est ci-dessous décrite plus en détail à l'aide d'un exemple de réalisation qui est comparé à un exemple comparatif de l'état de la technique. Pour évaluer les propriétés des couches, on exécute les mesures et les tests ci-dessous sur le vitrage revêtu.

- A. Mesure de la transmission T à 550 nm d'un vitrage revêtu
- B. Mesure des paramètres de teinte de la réflexion dans un système de laboracoire (DIN 5033), et on utilise comme référence de teinte un étalon ISO zéro. Sur les paramètres de teinte de cet étalon de référence, il faut maintenir des valeurs fixes de tolérance Δ qui
- 15 sont définies de la façon suivante pour le système de couches concerné ici, à l'état précontraint:

 $\Delta L = \pm 3.0$ ;  $\Delta a = \pm 1.4$ ;  $\Delta b = -3.5 à + 1.0$ 

- C. Mesure de la résistance électrique superficielle à 20 l'aide des appareils FPP 5000 Veeco Instr. et l'appareil manuel de mesure SQO HM-1
  - D. Mesure de l'émissivité E avec l'appareil Sten Löfving MK2

E. Test de ressuage à l'eau selon DIN 50017 avec évaluation visuelle

F. Mesure de la résistance électrochimique (test EMK);

30 ce test est décrit dans Z. Silikattechnik 32 (1981),
page 216. Le test permet une conclusion sur la qualité
de la passivation de la couche de recouvrement située
au-dessus de la couche d'argent, ainsi que sur le
comportement à la corrosion de la couche d'Ag

35

G. Test de lavage Erichsen selon ASTM 2486, évaluation visuelle

8

H. Mesure de la dureté au striage; on tire sur la couche à une vitesse définie une aiguille sollicitée par un poids. Le poids en g pour lequel des traces de rayures sont visibles sert de mesure de la dureté au striage

I. Mesure de la lumière diffusée, en %, avec un appareil de mesure de lumière diffusée de la firme Gardner.

10

25

5

4 :

## Exemple comparatif

Sur une installation industrielle de revêtement en continu, on applique le système de couches ci-dessous, de l'état de la technique (DE 39 41 027) à l'aide du procédé de pulvérisation cathodique réactive soutenue par champ magnétique sur du verre flotté, l'épaisseur des couches individuelles étant donnée chaque fois en nm:

20 verre/3TiO<sub>2</sub>/22SnO<sub>2</sub>/13ZnO:Al/12Ag/5TiAl/20SnO<sub>2</sub>/10TiO<sub>2</sub>

La couche de ZnO:Al est pulvérisée en condition réactive à partir d'une cible de ZnAl métallique avec 2 % en poids d'Al. La couche métallique sacrifiée est pulvérisée à partir d'une cible métallique qui contient 64 % en poids de Ti et 36 % en poids d'Al. La couche de recouvrement est déposée par pulvérisation réactive à partir d'une cible de titane métallique.

30 L'exécution des tests ci-dessus sur plusieurs échantillons avant le traitement thermique donne en moyenne les valeurs suivantes:

A. Transmission	$T_{550} = 76 - 77 \%$
B. Paramètres teinte	ΔL -0,1
	Δa 4,47
	Δb -5,31
C. Résistance superficielle	$R = 6.8 - 6.9 \Omega$

9	
D. Emissivité	E = 7,8
E. Test de ressuage à l'eau	taches rouges
F. Test EMK	140 mV
G. Test de lavage	début de décollement de la
	couche après 350 passes
H. Dureté au striage	60 - 210 g
I. Lumière diffusée	0,17 %

Plusieurs échantillons divers revêtus, d'une taille de 60 x 80 cm, sont chauffés à 680 - 700° C et précontraints par refroidissement brutal. Sur verres précontraints, on exécute ensuite les tests et mesures décrits plus loin. Le test de ressuage à l'eau, le test EMK, le test de lavage et le test de durêté au striage ne sont pas exécutés, parce que, par expérience, on sait que ces valeurs ne se détériorent pas après l'opération de traitement thermique. Les tests exécutés donnent le résultat suivant:

A. Transmission	$T_{550} = 88,5 \%$
B. Paramètres de teinte	ΔL 1,3
	Δa 1,56
	Δb -3,95
C. Résistance superficielle	
D. Emissivité	E = 5,8 - 6,8 %
I. Lumière diffusée	0,35 %

L'augmentation suite au traitement thermique de la proportion de lumière diffusée, de 0,17 % à 0,35 % est 15 encore tolérable. Une émissivité de 5,8 - 6,8 % est cependant trop élevée pour fabriquer des vitrages isolants présentant une valeur de k de 1,1  $W/m^2K$ . Les paramètres de teinte après la précontrainte sont situés 20 en dehors limites de tolérance. Les vitrage des présentent en réflexion un aspect visuel bleurougeâtre. De larges variations de l'épaisseur des différentes couches ne permettent pas davantage

10

d'obtenir une teinte de réflexion de couleur neutre avec les valeurs de teinte visées.

## Exemple de réalisation

Sur la même installation de revêtement que celle de l'exemple comparatif, on fabrique le système de couches ci-dessous, selon l'invention, en utilisant tant pour le dépôt de la couche métallique sacrifiée que pour le dépôt de la couche de recouvrement une cible métallique constituée d'un alliage de 64 % en poids de Ti et de 36 % en poids d'Al:

 $\label{eq:verre} $$ \operatorname{verre}/25SnO_2/9ZnO:Al/11,5Ag/2TiAl(TiH_x)/5ZnO:Al/33SnO_2/3Ti_xAl_yO_zN_r $$$ 

15

20

Le dépôt de la couche métallique sacrifiée s'effectue dans un mélange de gaz de travail d'Ar/ $H_2$  (90/10 % en volume) et le dépôt de la couche de recouvrement oxynitrurée dans un mélange de gaz de travail d'Ar/ $N_2/O_2$ .

Les mesures et les tests sur le vitrage revêtu avant le traitement thermique donne les valeurs suivantes:

A.	Transmission	$T_{550} = 78,3 \%$		
B.	Paramètres teinte	ΔL -0,9		
		Δa 2,80		
ļ		Δb -3,8		
C.	Résistance superficielle	R = 5,7 Ω		
D.	Emissivité	E = 6,6 - 6,7 %		
E.	Test de ressuage à l'eau	sans défaut		
F.	Test EMK	-64 mV		
G.	Test de lavage	pas de griffe après 1 000		
ļ		passes		
н.	Dureté au striage	150 - 260 g		
I.	Lumière diffusée	0,18 %		

Après la précontrainte, on excécute sur plusieurs échantillons les mêmes mesures et les mêmes tests que pour les vitrages précontraints de l'exemple comparatif. Les tests donnent le résultat suivant:

A. Transmission	$T_{550} = 88,3 \%$
B. Paramètres de teinte	ΔL 1,0
·	Δa 1,2
	Δb -2,4
C. Résistance superficielle	$R = 3, 6 - 4, 0 \Omega$
D. Emissivité	E = 4,8 - 5,0 %
I. Lumière diffusée	0,27 %

Tant sur la couche non traitée thermiquement que sur la couche traitée thermiquement, 10 les valeurs obtenues permettent de constater de nettes améliorations. particulier, la couche traitée thermiquement satisfait les paramètres de teinte prédéterminés. La teinte de réflexion est nettement plus neutre que dans l'exemple 15 comparatif. La dépendance fonctionnelle entre résistance superficielle et l'émissivité correspond mieux à la dépendance physique et permet de fabriquer des vitrages isolants présentant une valeur de k de 1,1 W/m<sup>2</sup>K. La proportion de lumière diffusée 20 nettement moins augmentée par le traitement thermique que dans l'exemple comparatif. Cela indique que couche d'Ag n'est que légèrement déstructurée. résultat des autres tests, par exemple le test ressuage à l'eau, le test EMK, le test de lavage et le test de dureté au striage qui ont été exécutés sur les 25 échantillons non traités thermiquement sont supérieur à la moyenne. Le système de couches peut être fabriqué de façon stable et reproductible sur une installation industrielle de revêtement.

#### REVENDICATIONS

WO 2004/013059

- 1. Système de couches à faible émissivité, apte à être fortement sollicité thermiquement, pour vitrages, avec de l'argent comme couche fonctionnelle, une couche 5 métallique sacrifiée disposée au-dessus de la couche d'argent, des couches diélectriques antiréfléchissantes et une couche de recouvrement oxydée, nitrurée ou oxynitrurée, caractérisé en ce que la couche métallique sacrifiée est constituée de Ti ou d'un alliage de Ti et 10 et/ou Al contient de et l'hydrogène chimiquement, en ce qu'une couche de ZnO éventuellement dopée à l'Al et/ou à l'In se raccorde à la couche métallique sacrifiée et en ce que la couche recouvrement est constituée d'un composé du titane. 15
  - 2. Système de couches selon la revendication 1, caractérisé en ce que la couche métallique sacrifiée est constituée d'un alliage TiAl contenant de 20 à 50 % en poids d'Al.
  - 3. Système de couches selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que la couche métallique sacrifiée présente une épaisseur de couche de 1 à 5 nm.

4. Système de couches selon la revendication 1 à 3, caractérisé en ce que la couche de ZnO contient de 0,5 à 10 % en poids d'Al et/ou d'In.

- 30 5. Système de couches selon la revendication 4, caractérisé en ce que la couche de ZnO présente une épaisseur d'au moins 3 nm.
- 6. Système de couches selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce qu'une couche de  $\mathrm{SnO}_2$ , de  $\mathrm{Si}_3\mathrm{N}_4$ , de  $\mathrm{ZnO}$ , d' $\mathrm{Al}_2\mathrm{O}_3$  et/ou de  $\mathrm{SiO}_2$  est disposée comme couche partielle de la couche diélectrique supérieure antiréfléchissante entre la couche de  $\mathrm{ZnO}$  et la couche

20

de recouvrement.

- 7. Système de couches selon l'une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que la couche de recouvrement est constituée de ZnO:Al/TiO<sub>2</sub>, ZnO:Al/Ti, Zn<sub>x</sub>Sn<sub>y</sub>O<sub>z</sub>/TiO<sub>2</sub>, Zn<sub>x</sub>Sn<sub>y</sub>O<sub>z</sub>/Ti, Zn<sub>x</sub>Ti<sub>y</sub>Al<sub>z</sub>O<sub>r</sub>, Ti<sub>x</sub>Al<sub>y</sub>O<sub>z</sub>, Ti<sub>x</sub>Al<sub>y</sub>, Ti<sub>x</sub>Al<sub>y</sub>N<sub>z</sub>, Ti<sub>x</sub>Al<sub>y</sub>O<sub>z</sub>N<sub>r</sub>, Zn<sub>x</sub>Sn<sub>y</sub>Sb<sub>z</sub>O<sub>r</sub>/TiO<sub>2</sub>, Zn<sub>x</sub>Sn<sub>y</sub>Sb<sub>z</sub>O<sub>r</sub>/TiO<sub>2</sub>.
- 10 8. Système de couches selon l'une des revendications 1 à 7, caractérisé par la structure de couche verre- $SnO_2$ - $ZnO:Al-Ag-TiAl(TiH_x)-ZnOAl-SnO_2Ti_xAl_yO_zN_r$ .

#### (12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

### (19) Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Bureau international



# I MANTE BANKATA A COMMO ANON BONA COMA COM AND I AN ESTAD HABBE ANA COMIT GAME AND AND AND AND COME

(43) Date de la publication internationale 12 février 2004 (12.02.2004)

PCT

# (10) Numéro de publication internationale WO 2004/013059 A3

- (51) Classification internationale des brevets<sup>7</sup>: C03C 17/36
- (21) Numéro de la demande internationale :

PCT/FR2003/002451

- (22) Date de dépôt international : 1 août 2003 (01.08.2003)
- (25) Langue de dépôt :

français

(26) Langue de publication :

français

(30) Données relatives à la priorité :

102 35 154.6 1 août 2002 (01.08.2002) DE

- (71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US): SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE [FR/FR]; 18, avenue d'Alsace, F-92400 Courbevoie (FR).
- (72) Inventeurs; et
- (75) Inventeurs/Déposants (pour US seulement): SCHICHT, Heinz [DE/DE]; Dorfstrasse 72, 06925 Bethau (DE). IHLO, Lars [DE/DE]; An Den Linden 50, 04889 Pflückuff (DE). SCHMIDT, Uwe [DE/DE]; Oststrasse 7, 04895 Falkenberg (DE). SCHINDLER, Herbert [—/DE]; 04860 Torgau (DE).
- (74) Mandataire: SAINT-GOBAIN RECHERCHE; 39, quai Lucien Lefranc, F-93300 Aubervilliers (FR).

- (81) États désignés (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, ŁK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) États désignés (régional): brevet ARIPO (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), brevet eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), brevet européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), brevet OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

#### Publiée:

- avec rapport de recherche internationale
- avant l'expiration du délai prévu pour la modification des revendications, sera republiée si des modifications sont recues
- (88) Date de publication du rapport de recherche internationale: 8 avril 2004

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.

(54) Title: PRESTRESSABLE LAYER SYSTEM FOR PARTITION GLASS

(54) Titre: SYSTEME DE COUCHES APTE A ETRE PRECONTRAINT, POUR VITRAGES

(57) Abstract: The inventive prestressable and flexural layer system with a low emissivity is used for a partition glass and is provided with a functional silver layer and a metallic sacrificed layer which is made of Ti or a Ti alloy and of Zn and/or Al and arranged thereunder. Said system also comprises anti-reflection dielectric layers and an oxidised covering layer which is nitrided or oxynitrided. The metallic sacrificed layer contains chemically bound hydrogen. A ZnO layer eventually stimulated with Al and/or In is adjacent to the metallic sacrified layer. The covering layer comprises a titanium compound. The analogous layer systems can be produced in a comparatively economical manner exhibiting a high hardness and chemical resistance. The colour parameters of said systems are easily reproducible even when they are thermally treated at a high temperature.

(57) Abrégé: Un système de couches à faible émissivité, apte à être cintré et précontraint, pour vitrages, avec de l'argent comme couche fonctionnelle, comprend une couche métallique sacrifiée, en Ti ou en un alliage de Ti et de Zn et/ou d'A1, disposée au-dessus de la couche d'argent, des couches diélectriques antiréfléchissantes et une couche de recouvrement oxydée, nitrurée ou oxynitrurée. La couche métallique sacrifiée contient de l'hydrogène lié chimiquement. Une couche de ZnO, éventuellement dopée à l'A1 et/ou à l'In, est adjacente à la couche métallique sacrifiée. La couche de recouvrement est constituée d'un composé de titane. Des systèmes de couches de ce type peuvent être fabriqués de manière relativement économique et présentent une dureté élevée et une haute résistance chimique. Leurs paramètres de teinte sont bien reproductibles, même en cas de traitement thermique à haute température.

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Interior para Application No PC17FR 03/02451

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC  8. PELDS SEARCHED  IPC 7 C03C  Documentation searched (classification system followed by classification symbols)  IPC 7 C03C  Documentation searched (classification system followed by classification symbols)  Encironic data base consulted during the international search (name of data base and, where puddical, search terms used)  EPO-Internal, PAJ, WPI Data  C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT  Calopory* Clatino of obcument, with indication, where appropriate, of the miewant passages  Relevant to claim  A US 4 749 397 A (LONE MARTIN ET AL)  7 June 1988 (1988-06-07)  cited in the application abstract column 5, line 8 – line 12  claim 1  A US 5 110 662 A (DEPAUM JEAN-MICHEL ET AL)  5 May 1992 (1992-05-05)  cited in the application abstract column 5, line 8 – line 20  Festivate data of the arm which is not abstract column 5, line 8 – line 20  Festivate data of the configuration of box C.  **Special categories of clied documents:  Column 5, line 8 – line 20  Festivate data of the configuration of the arm which is not abstract column 5, line 8 – line 20  Festivate of the search case specified or a claim the international fling date or priority data and not in confict with the application of the service of the search case of the second configuration of the se	A. CLASS	SIFICATION OF SUBJECT MATTER		PC17FR 03/02451
B. PELDS SEARCHED	IPC 7	C03C17/36		
Documentation searched (dissellication system followed by describication symbols)  Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched  Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)  EPO—Internal, PAJ, WPI Data  C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT  Category* A US 4 749 397 A (LOWE MARTIN ET AL) 7 June 1988 (1988-06-07) cited in the application abstract column 5, line 8 - line 12 claim 1  A US 5 110 662 A (DEPAUM JEAN-MICHEL ET AL) 5 May 1992 (1992-05-05) cited in the application abstract column 3, line 19 - line 35 column 5, line 8 - line 20  Further documents are listed in the continuation of box C.  Special categories of cloid documents.  A document destining the general state of the art which is not continued to the profit of the company of the	According	to International Patent Classification (IPC) or to both national	I classification and IPC	
Documentation searched other than minimum documentation to the ordert that such documents are accluded in the fields searched  Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)  EPO-Internal, PAJ, WPI Data  C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT  Callegory*  Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages  A US 4 749 397 A (LONE MARTIN ET AL)  June 1988 (1988-06-07)  cited in the application abstract column 5, line 8 - line 12 claim 1  A US 5 110 662 A (DEPAUM JEAN-MICHEL ET AL)  5 May 1992 (1992-05-05) cited in the application abstract column 3, line 19 - line 35 column 5, line 8 - line 20  Further documents are lated in the continuation of box C.  Special categories of clied documents:  ** document defining the general state of the art which is not considered to the optimizer terms of the damed involved in the continuation of the considered to the optimizer terms of the damed involved in involve an inventice step when the called on the continuation of the special reason (as specifier)  ** document stefering to an oral disclosure, use, exhibition or other makes of the column of the special reason (as specifier)  ** document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other makes of the column of the special reason (as specifier)  *** document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other makes of the column of the special reason (as specifier)  *** document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other makes of the column of the special reason (as specifier)  *** document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other makes of the column of the special reason (as specifier)  *** document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other special reason (as specifier)  *** document of particular relevance (in claimed with the arm of the same patent family)  ***Document of particular relevance (in claimed with the arm of the same patent family)  ***Document				
Electronic data base considered utring the international search (name of data base and, where practical, search terms used)  EPO-Internal, PAJ, WPI Data  C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT  Category*  Citation of document, with indication, where appropriate, of the retevant passages  Relevant to claim:  A US 4 749 397 A (LOWE MARTIN ET AL)  7 June 1988 (1988-06-07)  cited in the application abstract column 5, line 8 - line 12  claim 1  ——  A US 5 110 662 A (DEPAUW JEAN-MICHEL ET AL)  5 May 1992 (1992-05-05)  cited in the application abstract column 3, line 19 - line 35 column 5, line 8 - line 20  Further document defining the general state of the art which is not considered to the of particular relevance. The claimed involvion which is considered to be of particular relevance in technique or which is cled to establish the publication date of another citation of other special reason, special considered to involve an event separation of the relevance in technique or which is cled to establish the publication date of another citation of other special reason, special residual completed on or after the international string date or which is cled to establish the publication date of another citation or other special resource, the citamed involvion counter special resource, the citamed involvion of the considered to make a special resource, the citamed involvion counter special resource, the citamed involvion of considered to establish the publication date of another citation of other special resource, the citamed involvion counter special resource, the citamed involvion counter to considered to ensure the considered to member and considered to a special resource, the citamed involvion counter to consider the considered to member and considered to ensure the considered to member and considered to ensure the considered	IPC 7	documentation searched (classification system followed by ${\tt c03C}$	assification symbols)	
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT  Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages  A US 4 749 397 A (LOWE MARTIN ET AL) 7 June 1988 (1988-06-07) cited in the application abstract column 5, line 8 - line 12 claim 1  A US 5 110 662 A (DEPAUW JEAN-MICHEL ET AL) 5 May 1992 (1992-05-05) cited in the application abstract column 3, line 19 - line 35 column 5, line 8 - line 20  Further documents are listed in the continuation of box C.  X Patent family members are listed in annex.  Special categories of cited documents:  "To document published on or after the international filing date or promy date and not in continuation but of prompts of the prompts of th	Documenta	alion searched other than minimum documentation to the exte	ent that such documents are inclu	ded in the fields searched
Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages  Belevant to claim!  A US 4 749 397 A (LOWE MARTIN ET AL) 7 June 1988 (1988-06-07) cited in the application abstract column 5, line 8 - line 12 claim 1  A US 5 110 662 A (DEPAUW JEAN-MICHEL ET AL) 5 May 1992 (1992-05-05) cited in the application abstract column 3, line 19 - line 35 column 5, line 8 - line 20  Further documents are listed in the continualion of box C.  X Patent family members are listed in annex.  Special categories of cited documents:  A document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance considered to be of particular relevance or which is categories of cited documents:  A document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance or which is categories of cited documents or princy deliver(s) or considered to each with the application to order the international fling date or which is categories or cited documents or approximate to each with the application to order the international fling date or which is categories or cited documents or application or other special reason (as specified) or order in the international fling date but solve in the international fling date but solve in the international search 18 February 2004  arms and mailing address of the ISA European Palent Citics, P.B. 5818 Patentiana 2 N.L 2801 N Figsion, 13 45 651 epo nl. Fix (431-70) 340-3040, Tx. 31 561 epo			data base and, where practical,	search terms used)
Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages  A US 4 749 397 A (LOWE MARTIN ET AL) 7 June 1988 (1988-06-07) cited in the application abstract column 5, line 8 - line 12 claim 1  A US 5 110 662 A (DEPAUW JEAN-MICHEL ET AL) 5 May 1992 (1992-05-05) cited in the application abstract column 3, line 19 - line 35 column 5, line 8 - line 20  Further documents are listed in the continuation of box C.  Special categories of clied documents:  A' document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance; but a considered to be of particular relevance; or priority date and not in conflict with the application but or priority date and not in conflict with the application but or priority date and not in conflict with the application but or priority date and not in conflict with the application but or priority date in a considered to be considered to be considered to exclude the priority date claimed; or priority date claimed invention cannot be considered to entire the same particular relevance; the claimed invention cannot be considered to entire the same particular relevance; the claimed invention cannot be considered to entire the same particular relevance; the claimed invention cannot be considered to entire the same particular relevance; the claimed invention cannot be considered to entire the same particular relevance; the claimed invention cannot be considered to entire the priority date claimed.  18 February 2004  The actual completion of the international search  18 February 2004  The actual completion of the international search  19 Calcument and particular relevance; the claimed invention cannot be considered to entire the particular relevance; the claimed invention cannot be considered to entire the particular relevance; the claimed invention cannot be considered to entire the particular relevance; the claimed invention cannot be considered to entire the particular relevance; the claimed invention cannot be considered to ent	FLO-IU	iternal, PAJ, WPI Data		
A US 4 749 397 A (LOWE MARTIN ET AL) 7 June 1988 (1988-06-07) cited in the application abstract column 5, line 8 - line 12 claim 1  A US 5 110 662 A (DEPAUW JEAN-MICHEL ET AL) 5 May 1992 (1992-05-05) cited in the application abstract column 3, line 19 - line 35 column 5, line 8 - line 20  Further documents are listed in the continuation of box C.  Special categories of cited documents:  A' document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance E' earlier document but published on or after the international filing date or promy date across the desired of another which is not one steel of ostablish the publication date of another which is not of the published on or after the international filing date or promy date across the desired of the publication date of another which is not office the published of the publication date of another which is not onsidered to ostablish the publication date of another of the same published promote of cannot be considered to which state the document aftering to an oral disclosure, use, exhibition or other means.  C' document of particular relevance in extern alone invention cannot be considered to invention cannot be considered to invention cannot be considered to invention cannot be combined to being obvious to a person skilled means.  C' document of particular relevance invention cannot be combined with not even other such documents, such combin	C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
7 June 1988 (1988–06–07) cited in the application abstract column 5, line 8 – line 12 claim 1  A US 5 110 662 A (DEPAUW JEAN-MICHEL ET AL) 5 May 1992 (1992–05–05) cited in the application abstract column 3, line 19 – line 35 column 5, line 8 – line 20  Further documents are listed in the continuation of box C.  X Patent family members are listed in annex.  Special categories of cited documents:  A' document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance  C' earlier document but jublished on or after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but considered to be of particular relevance (as specified)  Od on the respectal reson (as specified) C' document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means. C' document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means. C' document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means. C' document reperring the claimed invention cannot be considered to whole an inventive step when the document of combined with not error either such document in combined with not error either such document in combined with not error either such document in the art in combined with not error either such document in the art in combined with not error either such document in the art in combined with not error either such document in the art in combined with not error either such document in the art in combined with not error either such document in the art in combined with not error either such document in the art in combined with not error either such document in the art in combined with not error either such document in the art in combined with not error either such document in the art in combined with not error either such document in combined with not error either such document in combined with not error either such document in the art in combined with not error either such document in combined with not error either such document in the art in combined with	Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, or	of the relevant passages	Relevant to claim No.
Column 5, line 8 - line 12 claim 1  US 5 110 662 A (DEPAUW JEAN-MICHEL ET AL)  5 May 1992 (1992-05-05) cited in the application abstract column 3, line 19 - line 35 column 5, line 8 - line 20  Further documents are listed in the continuation of box C.  Special categories of cited documents:  A' document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance  Fearlier document but published on or after the international filing date  'T' later document up the special reason (as specified) 'Y' document of particular relevance invention for the property of the special reason (as specified)  "Y' document of particular relevance invention of the reason of the publication date of another of document which may throw doubts on priority claim(s) or which is clad to establish the publication date of another of document of particular relevance in the claimed invention of the reason (as specified)  "Y' document of particular relevance in claimed invention cannot be considered to review and invention to document is combined with one or more other such documents, such combination being down one other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.  18 February 2004  ame and mailing address of the ISA  European Patent Office, P.B. 5818 Patentlana 2 NL - 2200 IN Playerity Tel. (1-70) 340-290, T. 3.1 651 epo nl. Fix: (31-70) 340-290, T. 3.3 651 epo nl. Fix: (31-70) 340-290, T. 3.3 651 epo nl.	A	7 June 1988 (1988-06-07) cited in the application	ET AL)	1-8
Further documents are listed in the continuation of box C.    Further documents are listed in the continuation of box C.   X   Patent family members are listed in annex.		column 5, line 8 - line 12		
Special categories of cited documents:  A' document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance  E' earlier document bull published on or after the international filing date  c' document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)  O' document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means  c' document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed  18 February 2004  18 February 2004  The succession of the ISA  European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  NL - 2280 HV Rijswijk, Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016  The art which is not considered to involve an invention of involve an inventive step when the document is cambined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.  *T' later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.  *a' document member of the same patent family  Date of mailing of the international search report  26/02/2004  Authorized officer  Picard, S	A	5 May 1992 (1992-05-05) cited in the application abstract column 3, line 19 - line 35	IICHEL ET AL)	1-8
Special categories of cited documents:  A' document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance  E' earlier document but published on or after the international filing date  L' document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)  O' document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means  P' document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed  18 February 2004  T'' later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention of cannot be considered to end be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.  '&' document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.  '&' document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.  '&' document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.  '&' document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.  '&' document of particular relevance; the claimed inv	Further	of documents are listed in the country of		
A' document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance  E' earlier document but published on or after the international filing date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention filing date are document but published on or after the international filing date are document but published on or after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention  "X' document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone with one or more other such document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.  **A' document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention and the principle or theory underlying the invention and the principle or theory underlying the invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combined with one or more other such documents, such combined with one or more other such documents, such combined with one or more other such documents is combined with one or more other such documents, such combined with one or more other such documents is combined with one or more other such documents is combined with one or more other such documents is combined with one or more other such documents is combined with one or more other such documents is combined with one or more other such documents.  **T atter document prolifer wither invention and invention and invention and invention and invention			X Patent family me	mbers are listed in annex.
Date of the actual completion of the international search  18 February 2004  Iame and mailing address of the ISA  European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  NL - 2280 HV Rijswijk  Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016  Date of mailing of the international search report  26/02/2004  Authorized officer  Picard, S	A* document consider earlier do filing data which is citation of document other me document d	at defining the general state of the art which is not red to be of particular relevance ocument but published on or after the international te to the total state of the stabilish the publication date of another or other special reason (as specified) at referring to an oral disclosure, use, exhibition or eans.	"X" document of particular cannot be considered involve an inventive st "Y" document of particular cannot be considered cannot be considered document is combined ments, such combinat in the art.	relevance; the claimed invention novel or cannot be considered to lep when the document is: taken alone relevance; the claimed invention novel or cannot be considered to lep when the document is: taken alone relevance; the claimed invention to involve an Inventive step when the d with one or more other such docuion being obvious to a person skilled
18 February 2004  ame and mailing address of the ISA  European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016  26/02/2004  Authorized officer  Picard, S				
European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016  Picard, S	18	February 2004	ĺ	
Pax: (+31-70) 340-3016 Picard, S	ame and ma	European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Riiswiik	Authorized officer	
PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)		Pax: (+31-70) 340-3016	Picard, S	

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

PCT/FR 03/02451

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
US 4749397	A	07-06-1988	AT	115098 T	15-12-1994
			AU	585426 B2	15-06-1989
			AU	6799187 A	30-07-1987
			BR	8700383 A	08-12-1987
			CA	1262843 A1	14-11-1989
			DE	3750823 D1	19-01-1995
			DE	3750823 T2	18-05-1995
			DE	233003 T1	17-03-1988
			EP	0233003 A1	19-08-1987
			ES	2000241 T3	01-04-1995
			FΙ	870378 A ,B,	30-07-1987
			GB	2186001 A ,B	05-08-1987
			JP	2509925 B2	26-06-1996
			JP	62235232 A	15-10-1987
			KR	9514102 B1	21-11-1995
			MX	167806 B	13-04-1993
			US	4894290 A	16-01-1990
			ZA	8700445 A	30-09-1987
US 5110662	A	05-05-1992	BE	1002992 A3	15-10-1991
			CH	679580 A5	13-03-1992
			DE	3941027 A1	12-07-1990
			DK	635589 A	06-07-1990
			FR	2641271 A1	06-07-1990
			GB	2229737 A ,B	03-10-1990
			JP	2289449 A	29-11-1990
			JP	2876325 B2	31-03-1999
			LU	87646 A1	10-07-1990
			NL	8903147 A ,B,	01-08-1990
			NO	894864 A ,B,	06-07-1990
			SE	469523 B	19-07-1993
			SE	8904231 A	06-07-1990

# RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

PCT/FR 03/02451

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE CIB 7 C03C17/36					
Selon la cla	Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB				
	NES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE	editor nationale et id CID			
	tion minimale consultée (système de classification suivi des symboles	de classement)			
CIB 7	CO3C				
Documental	tion consultée autre que la documentation minimale dans la mesure o	ù ces documents relèvent des domaines s	sur lesquels a porté la recherche		
Base de do	nnées électronique consultée au cours de la recherche internationale	(nom de la base de données, et si réalisat	ole, termes de recherche utilisés)		
EPO-In	ternal, PAJ, WPI Data				
C. DOCUME	ENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS				
Catégorie °	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication	des passages pertinents	no. des revendications visées		
A	US 4 749 397 A (LOWE MARTIN ET A 7 juin 1988 (1988-06-07) cité dans la demande	L)	1-8		
	abrégé colonne 5, ligne 8 - ligne 12 revendication 1				
Α	US 5 110 662 A (DEPAUW JEAN-MICHE 5 mai 1992 (1992-05-05) cité dans la demande abrégé colonne 3, ligne 19 - ligne 35 colonne 5, ligne 8 - ligne 20	L ET AL)	1-8		
	la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents	Les documents de familles de bre	evets sont indiqués en annexe		
<ul> <li>Categones spéciales de documents cités:</li> <li>A' document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent</li> <li>E' document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date</li> <li>L' document pouvant jeter un doute sur une revendication de pnorité ou cité pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)</li> <li>O' document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens</li> <li>P' document publié avant la date de dépôt internațional, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée</li> <li>T' document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie considiuant la base de l'invention</li> <li>X' document particulièrement pertinent; l'inven tion revendiquée inventive par rapport au document considéré solément</li> <li>Y' document particulièrement pertinent; l'inven tion revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré inventive par rapport au document pertinent; l'inven tion revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive par rapport au document pertinent; l'inven tion revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive par rapport au document pertinent; l'inven tion revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive par rapport au document pertinent; l'inven tion revendiquée ne peut être considérée comme ne peut être considérée</li></ul>					
Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée  Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale					
18 février 2004 26/02/2004					
Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016  Figure 1 de l'administration chargée de la recherche internationale Fonctionnaire autorisé  Fonctionnaire autorisé  Picard, S					

## RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

PCT/FR 03/02451

					33/ 02431
Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication		Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
US 4749397	Α	07-06-1988	AT	115098 T	15-12-1994
			AU	585426 B2	15-06-1989
			AU	6799187 A	30-07-1987
			BR	8700383 A	08-12-1987
			CA	1262843 A1	14-11-1989
			DE	3750823 D1	19-01-1995
			DE	3750823 T2	18-05-1995
			DΕ	233003 T1	17-03-1988
			EP	0233003 A1	19-08-1987
			ES	2000241 T3	01-04-1995
			FΙ	870378 A ,B,	30-07-1987
			GB	2186001 A ,B	05-08-1987
			JР	2509925 B2	26-06-1996
			JP	62235232 A	15-10-1987
			KR	9514102 B1	21-11-1995
			MX	167806 B	13-04-1993
			US	4894290 A	16-01-1990
			ZA	8700445 A	30-09-1987
US 5110662	Α	05-05-1992	BE	1002992 A3	15-10-1991
			CH	679580 A5	13-03-1992
•			DE	3941027 A1	12-07-1990
			DK	635589 A	06-07-1990
			FR	2641271 A1	06-07-1990
			GB	2229737 A ,B	03-10-1990
			JP	2289449 A	29-11-1990
			JP	2876325 B2	31-03-1999
		-	LU	87646 A1	10-07-1990
			NL	8903147 A ,B,	01-08-1990
			NO	894864 A ,B,	06-07-1990
			SE	469523 B	19-07-1993
			SE	8904231 A	06-07-1990

THIS PAGE BLANK (USPTO)

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to	the items checked:
☐ BLACK BORDERS	
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES	
☐ FADED TEXT OR DRAWING	
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES	
$\square$ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS	
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS	
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE P	POOR QUALITY

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

# THIS PAGE BLANK (USPTO)